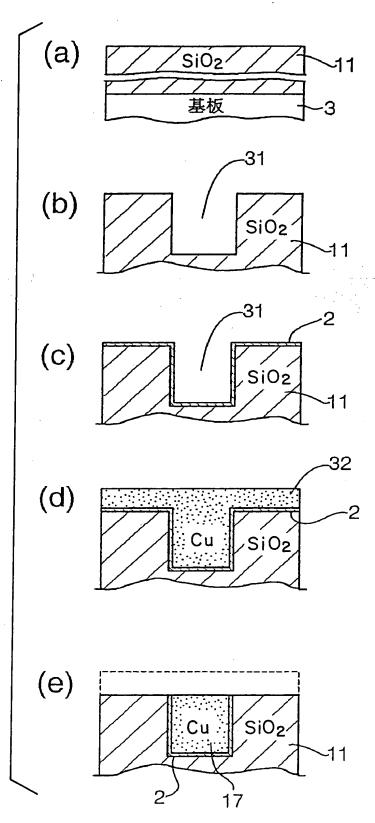


FIG. I



F I G. 2

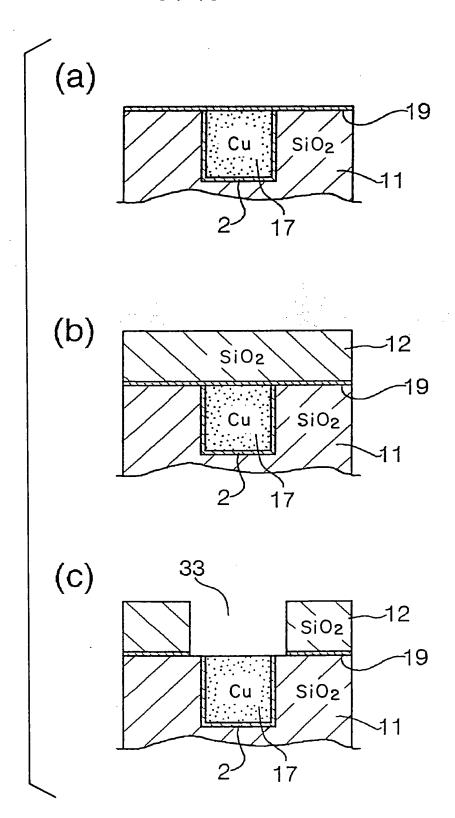


FIG. 3

.

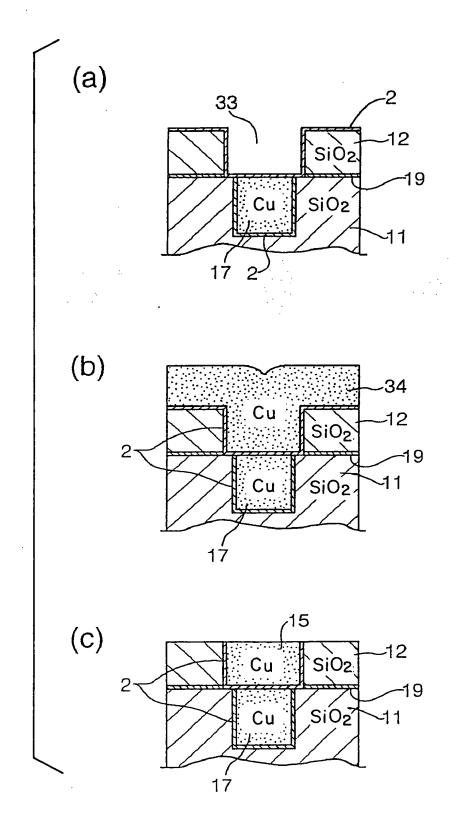
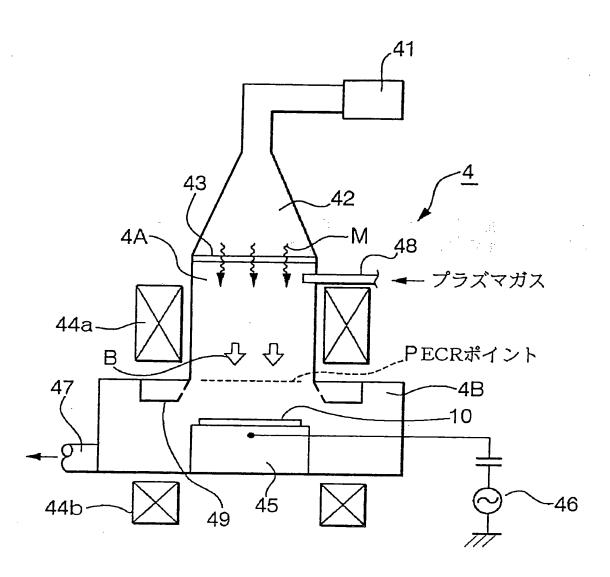


FIG. 4



F I G. 5

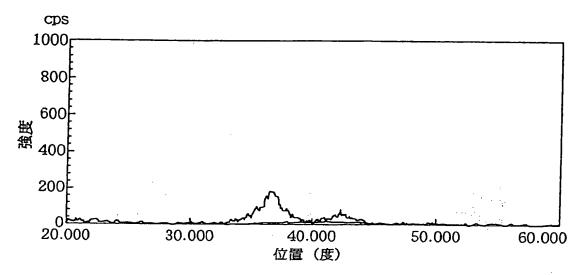
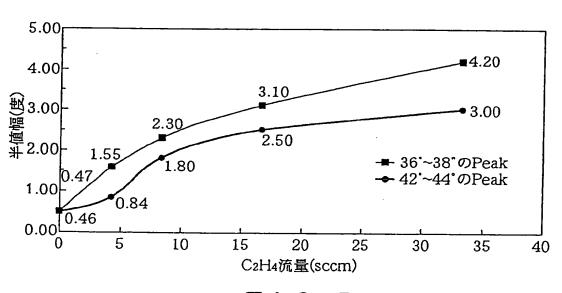


FIG. 6



F1G. 7

	半伯		
C2H4流量 (SCCM)	第1のピーク	第2のピーク	Cuに対する バリア性
0	0.46	0.47	0
4.2	1.55	0.84	Ö
8.3	2.30	1.80	Ö
16.7	3.10	2.50	$\triangle$
33.3	4.20	3.00	×

FIG. 8

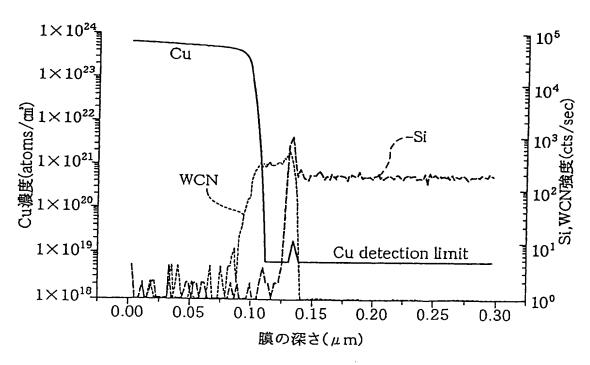
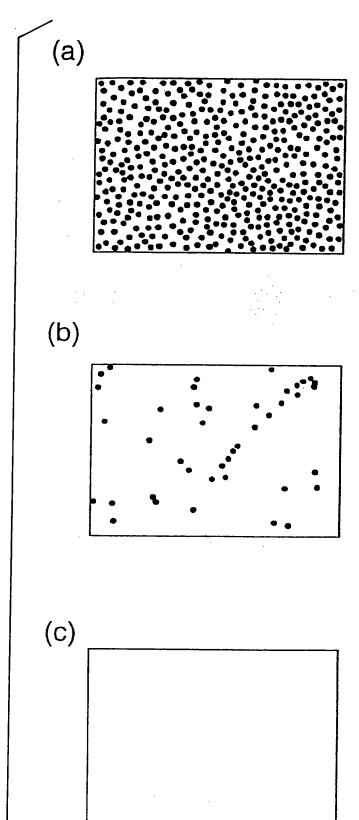


FIG. 9

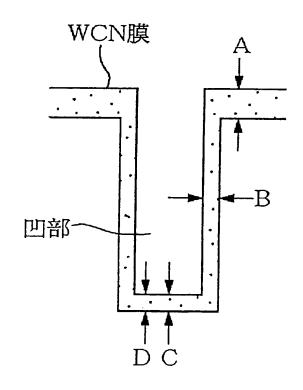




F1G. 10

***	半值		
ガス種	第1のピーク	第2のピーク	Cuに対する バリア性
C2H4	2.3	1.8	0
C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	3.2	2.6	$\triangle$
C2H2	1.9	1.6	O

F1G.11



F I G. 12

	カバレッジ(%)		
	B/A	C/A	D/A
WCN	20	32	28
WN	16	24	20

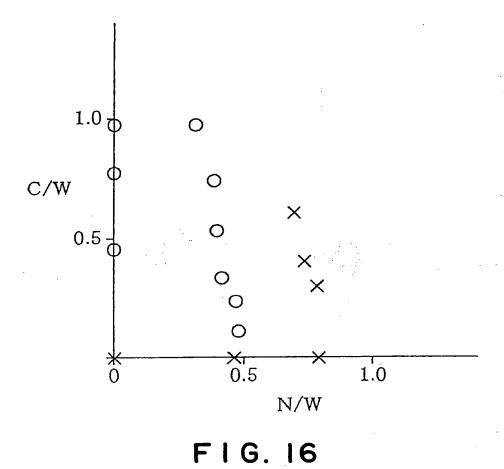
FIG. 13

•	密着力(kpsi)	
	SiO <sub>2</sub>	SiN
WCN	4.5	4.2
WN	2.3	1.8

F1G. 14

N/W比	C/W比	密着性(kpsi) SiO2
0	0	<1/<1
0	0.48	5.0/4.7
0	0.79	6.2/5.1
0	0.98	5.4/3.7
0	1.23	5.4/4.2
0.48	0	2.3/1.8
0.49	0.12	4.0/3.7
0.47	0.24	4.5/4.2
0.42	0.34	6.2/5.2
0.4	0.54	4.2/3.9
0.39	0.75	5.1/4.2
0.32	0.98	6.1/3.4
0.79	0	2.1/1.2
0.78	0.3	2.8/1.8
0.74	0.41	2.1/2.4
0.7	0.62	2.6/2.0

FIG. 15



0.5.4	A 3417	7047	O *7	T 47
CF4	A部	B部	C部	D部
0sccm	100%	16%	24%	20%
4.2sccm	100%	23%	36%	30%
8.3sccm	100%	27%	40%	34%
16.7sccm	100%	32%	45%	38%
C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>				:
8.3sccm	100%	20%	32%	28%

F I G. 17

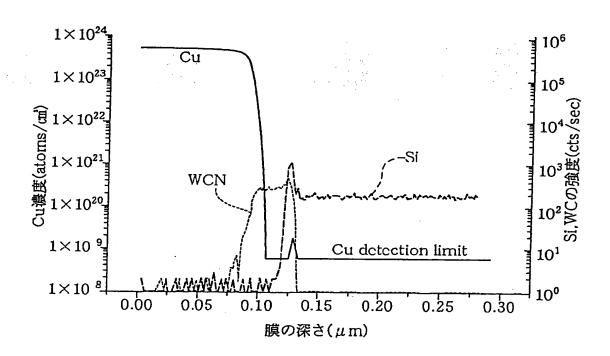


FIG. 18

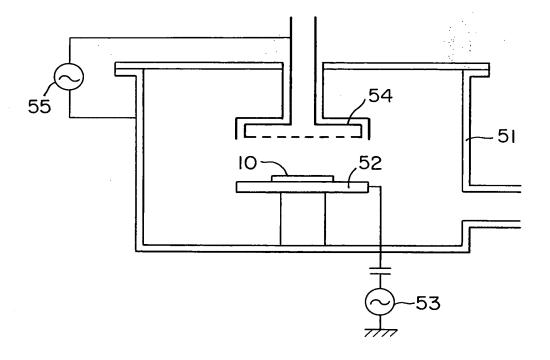


FIG. 19

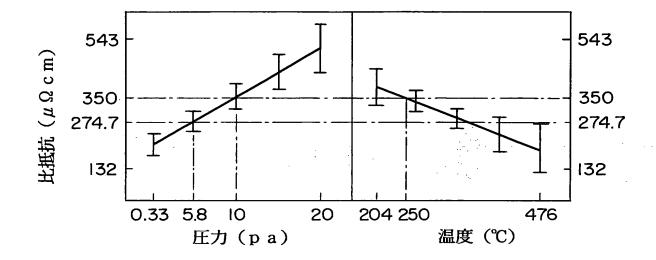


FIG. 20

比抵抗	半値幅		
$(\mu\Omega cm)$	第1のピーク	第2のピーク	
189	1.62	0.91	
275	2.31	1.65	
347	3.05	2.39	
420	4.02	2.98	
491	4.78	3.52	

FIG. 21